

NUBIC知的財産情報開示

開示日： 2008年02月29日

各位

NUBIC知的財産情報の要約をお届けいたします。
尚、NUBICベンチャークラブ特別会員、一般会員にはすでにお知らせしています。

	NUBIC管理番号: <input type="text" value="2005000086"/>	整理番号 <input type="text" value="10919"/>	担当者 <input type="text" value="谷中 秀臣"/>
表 題	<input type="text" value="ガスパフ型プラズマフォーカス装置"/>		
技術分野	<input type="text" value="電気・電子"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
適用製品	<input type="text" value="半導体露光装置, X線顕微鏡"/>		
目 的	<input type="text" value="空間に孤立したガスを用いたプラズマフォーカス放電により、長寿命で高効率の極端紫外から軟X線領域における点光源を提供する。"/>		
技術概要	<p>プラズマフォーカス装置はプラズマが一点に収束するため、極端紫外から軟X線領域の点光源として利用することができる。この装置は従来、ガスを詰めた状態で運転されており、ピンチ時の再放電による入力エネルギーの限界、およびプラズマの大部分が膨張するためエネルギーの利用効率の低さが課題となっていた。</p> <p>本発明は中心導体内部に高速ガスバルブを取り付け、電極先端部のガスノズルから中空円錐状のガスパフを行うことにより、絶縁物の沿面放電によらずにガスに沿ってプラズマフォーカス放電を開始するものである。これにより、絶縁物の劣化が防止でき、再放電を起りにくくすることで入力エネルギーを増加させることができる。また、プラズマの軸方向運動を減らすことにより入力エネルギーの利用効率を高めることができる。</p>		

技術移転等をご希望の場合は、下記事項をご記入の上、本用紙にてお申込みください。

(FAX, e-mail, 郵送いずれでも可。)

各担当コーディネーターからご連絡を差し上げます。

面談希望日時	<input type="text"/>		
(ふりがな) 氏 名	<input type="text"/>		
会社名	<input type="text"/>		
所 属	<input type="text"/>	役職	<input type="text"/>
電話番号	<input type="text"/>	FAX番号	<input type="text"/>
E-mail	<input type="text"/>		
連絡事項	<input type="text"/>		



【申込み・問い合わせ先】

日本大学産官学連携知財センター(NUBIC)

〒102-8275 東京都千代田区九段南4-8-24 日本大学会館

TEL:03-5275-8139 FAX:03-5275-8328 E-mail:nubic@nihon-u.ac.jp